



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

柔性电子基板上薄膜材料可靠性原位测试系统及方法

文献类型: 专利

作者 张广平,朱晓飞,张滨

发表日期 2011-09-21

专利国别 中国

权利人 中国科学院金属研究所

公开日期 2013-06-19

语种 中文

专利申请号 200810228254.3

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/68289>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 张广平,朱晓飞,张滨. 柔性电子基板上薄膜材料可靠性原位测试系统及方法. 2011-09-21.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
109	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。